

# 多ゾーン加熱Cvdチューブ炉 マシン 化学気相成長チャンバー システム装置

商品番号: KT-CTF14



前書き

KT-CTF14 多ゾーン加熱CVD炉 -

高度なアプリケーション向けの精密な温度制御とガスフロー。最高温度1200℃、4チャンネルMFC質量流量計、7インチTFTタッチスクリーンコントローラー搭載。

[詳細を学ぶ](#)

|            |                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 炉モデル       | KT-CTF14-60                                                                        |
| 最高温度       | 1400℃                                                                              |
| 定常作業温度     | 1300℃                                                                              |
| 炉管材質       | 高純度Al2O3管                                                                          |
| 炉管径        | 60mm                                                                               |
| 加熱ゾーン      | 2x450mm                                                                            |
| チャンバー材質    | アルミナ多結晶繊維                                                                          |
| 発熱体        | 炭化ケイ素                                                                              |
| 昇温速度       | 0-10℃/分                                                                            |
| 熱電対        | S型                                                                                 |
| 温度コントローラー  | デジタルPIDコントローラー/タッチスクリーンPIDコントローラー                                                  |
| 温度制御精度     | ±1℃                                                                                |
| ガス精密制御ユニット |                                                                                    |
| 流量計        | MFC質量流量計                                                                           |
| ガスチャンネル    | 4チャンネル                                                                             |
| 流量         | MFC1: 0-5SCCM O2<br>MFC2: 0-20SCCMCH4<br>MFC3: 0-100SCCM H2<br>MFC4: 0-500 SCCM N2 |
| 直線性        | ±0.5% F.S.                                                                         |
| 再現性        | ±0.2% F.S.                                                                         |
| 配管およびバルブ   | ステンレス鋼                                                                             |
| 最大動作圧力     | 0.45MPa                                                                            |
| 流量計コントローラー | デジタルノブコントローラー/タッチスクリーンコントローラー                                                      |

## 標準真空ユニット（オプション）

|         |               |
|---------|---------------|
| 真空ポンプ   | ロータリーベーン真空ポンプ |
| ポンプ流量   | 4L/S          |
| 真空吸込ポート | KF25          |
| 真空計     | ピラニ/抵抗シリコン真空計 |
| 定格真空度   | 10Pa          |

## 高真空ユニット（オプション）

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| 真空ポンプ   | ロータリーベーンポンプ+分子ポンプ     |
| ポンプ流量   | 4L/S+110L/S           |
| 真空吸込ポート | KF25                  |
| 真空計     | 複合真空計                 |
| 定格真空度   | 6x10 <sup>-5</sup> Pa |

上記の仕様およびセットアップはカスタマイズ可能です

| 番号 | 説明           | 数量 |
|----|--------------|----|
| 1  | 炉            | 1  |
| 2  | 石英管          | 1  |
| 3  | 真空フランジ       | 2  |
| 4  | チューブ熱ブロック    | 2  |
| 5  | チューブ熱ブロックフック | 1  |
| 6  | 耐熱手袋         | 1  |
| 7  | 精密ガス制御       | 1  |
| 8  | 真空ユニット       | 1  |
| 9  | 操作マニュアル      | 1  |